

Politechnika Świętokrzyska  
25 – 314 Kielce  
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

Kielce, dnia 31.07.2018 r.

ATZ- /2018

## WSZYSCY WYKONAWCY

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury naukowo-badawczej: Platformy badawczej: nano- i mikrotwardościomierz, nano- i mikroscratchtester; Nanotribometra; Mikroskopu nastołowego SEM z możliwością analizy wielkości nanocząstek; Reflektometra i Kalotestera; Tribometra; Zestawu do preparatyki próbek; Mikroskopu konfokalnego dla Laboratorium Zaawansowanych Nanotechnologii i Nanomateriałów Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo-Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”]

Nr ogłoszenia w Dz.Urz UE: 2018/S 125-284412 z dnia 04.07.2018, znak: ATZ-381-18/18

W związku z wniesionymi zapytaniami wykonawców o wyjaśnienie niektórych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający stosownie do art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej Pzp, wyjaśnia co następuje:

### PYTANIA (Dotyczy części 7 postępowania)

#### 1. W specyfikacji jest:

Automatyczny stolik wraz z obrotową płytką do przemieszczania próbek w zakresie 256x215mm. Konstrukcja urządzenia powinna umożliwiać położenie na stoliku elementów o większych gabarytach – maksymalna wysokość próbki: 30cm

Czy zamawiający akceptuje rozwiązanie stabilniejsze, o lepszych rozdzielczościach w postaci automatycznego stolika sterowanego przy pomocy joysticka wraz z obrotową płytką do przemieszczania próbek o maksymalnej wysokości 40mm w zakresie 110x75mm?

#### 2. W specyfikacji jest:

Manualny układ przesuwu głowicy pomiarowej w osi Z w zakresie 0-150mm

Czy zamawiający akceptuje rozwiązanie bardziej stabilne z automatycznym przesuwem w osi z od 0-40mm oparte o ultra precyzyjny automatyczny układ mechaniczny?

### Odpowiedzi:

Ad.1. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, jeśli rozdzielczość stolika będzie lepsza niż 0,01µm zaś repozycja lepsza niż 0,5µm. Ponadto urządzenie musi gwarantować możliwość zainstalowania stolika 256x215mm w każdej chwili.

Ad.2. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, jeśli stabilność urządzenia będzie umożliwiała osiągnięcie wyników z rozdzielczością:



- poprzeczną (na płaszczyźnie) poniżej 140nm i w osi Z poniżej 2nm dla trybu konfokalnego
- poprzeczną (na płaszczyźnie) 250nm i w osi Z poniżej 0,1nm dla trybu interferometrycznego

Ponadto urządzenie musi zagwarantować powtarzalność wyników na poziomie:

- 3nm dla trybu konfokalnego i interferometrycznego VSI
- 0,2nm dla trybu interferometrycznego PSI

Urządzenie musi gwarantować możliwość zainstalowania w każdej chwili kolumny do 150mm jeśli zajdzie taka potrzeba.

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie części 7 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 oraz dokonuje zmiany pkt 1 rozdziału XII **Miejsce i termin składania ofert** oraz rozdziału XIII SIWZ **Miejsce i termin otwarcia ofert**, które w miejsce dotychczasowych otrzymują brzmienie:

## **„XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT**

1. Ofertę należy złożyć w Politechnice Świętokrzyskiej Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 (Budynek „B”) pokój nr 2.33 w terminie **do 04.09.2018 r. do godz.12<sup>00</sup>”**

## **„XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT**

Otwarcie ofert nastąpi w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 (Budynek „B”) pokój nr 2.33 w dniu **04.09.2018 r. o godz.13<sup>00</sup>.”**